

研究報告

2015/11/13 M2 厚田耕佑

実施内容

- ・ 偏光状態測定
- ・ スペクトル幅測定
- ・ パルス幅測定

偏光状態を示す。偏光子(検光子)を回して取得した。偏光状態に大きな違いは無かった。

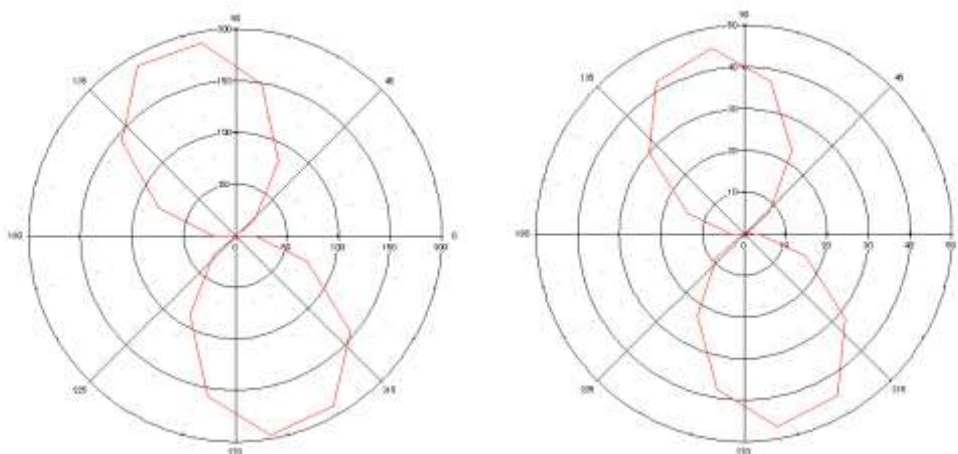


Fig.1 入射(左)および PCF 後(右)

スペクトル幅を測定した。Cr:F 光源に使用している光スペアナを使用した。どちらも 30nm 程度であったが、ファイバ出口ではややスペクトル形状の変化が見られた。

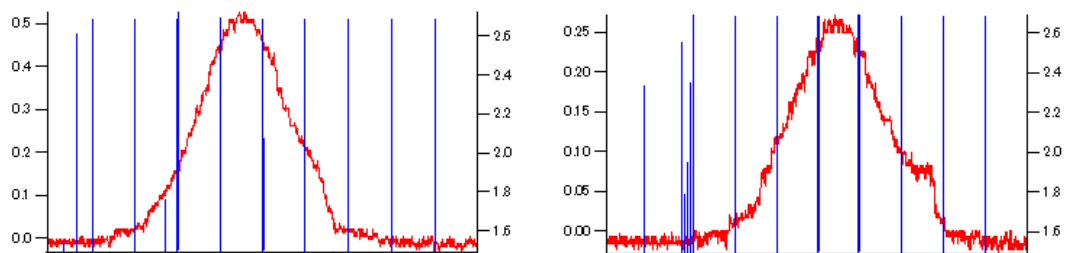


Fig.2 スペクトル波形

次に、オートコリレータを用いたパルス幅測定を行った。水平成分が最も強い光を入射させた。本測定ではオシロを用いて波形を見た。パルス波形を取得することができたが、解析をしてみると、フィッティングが上手くいっていないため、ゲインやセンシビリティなどの設定を見直す必要があると考えられる。

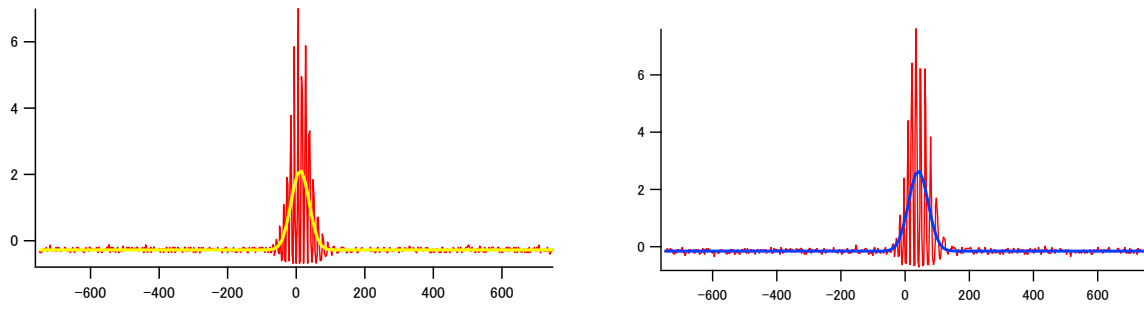


Fig.3 パルス波形

今後の予定@計画表

ファイバデリバリー：パルス幅の正確な測定．SMF と融着．

Table.1 計画表

	10月			11月			12月		
インターフェイス(ステージ)									
インターフェイス(プローブ)									
THG検出									
ファイバデリバリー									
ハンドヘルド(アーム)計測									
						≡≡≡ 予定			準備中
									実施中
									完了